

LF真空プラズマクリーナー CIONEシリーズ



- 電極反転機能を標準装備。
- RIEモードでナノエッチングが可能。
- タッチパネルPCを刷新。より使用しやすくなりました。
- 特許取得のガスフローデザインで均一な処理ができます。
- すべての制御がデジタルで、高い再現性が保たれます。
- 最大10レシピを保存できます。

機種名	CIONE4	CIONE6	CIONE8
チャンパー (内径)	アルミチャンパー W140 × D200 × H110mm	アルミチャンパー W200 × D220 × H160mm	アルミチャンパー W250 × D300 × H200mm
ガス導入口数	1(マスフローコントローラー)	1(マスフローコントローラー)	1(マスフローコントローラー)
周波数/出力	20~100 kHz /100 W	20~100 kHz /200 W	20~100 kHz /300 W
真空度	760 ~ 1 x10 ⁻³ Torr	760 ~ 1 x10 ⁻³ Torr	760 ~ 1 x10 ⁻³ Torr
コントロール	タッチパネル	タッチパネル	タッチパネル
装置寸法 (mm)	W460 x D500(620)x H580mm	W498 x D550(670)x H620mm	W600 x D650(770)x H620mm
ジョイント	Gas : 1/4" Swagelok- fitting	Gas : 1/4" Swagelok- fitting	Gas : 1/4" Swagelok- fitting
電源	110~120 VAC, 50/60Hz, 1Ph	110~120 VAC, 50/60Hz, 1Ph	110~120 VAC, 50/60Hz, 1Ph

オプション : ガスチャンネル 2ライン追加可能

1) ナノバイオサイエンス分野

ラボ オン チップ リサーチ
 アミノ基 プラズマ接合
 グルコースセンサー, プロテインチップ

PDMS接合, ガラス表面のクリーニング
 プラスチックの表面処理: 親水性 / 疎水性
 マイクロプラズマ, 酵素調整の前処理など

2) MEMS, 自動車産業, マイクロエレクトロニクス分野, 他

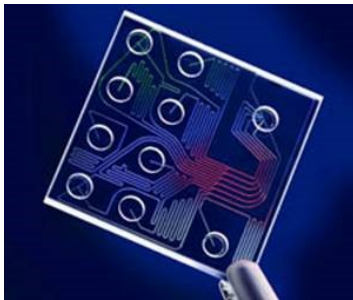
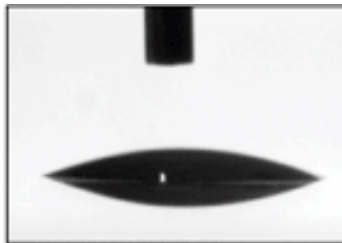
MEMS 研究分野
 プラスチック研究分野
 自動車産業分野
 医学・歯学分野

有機不純物の除去・ナノエッチング
 コーティング前の表面活性化
 シリコンボンディングの活性促進
 チタン表面の親水化

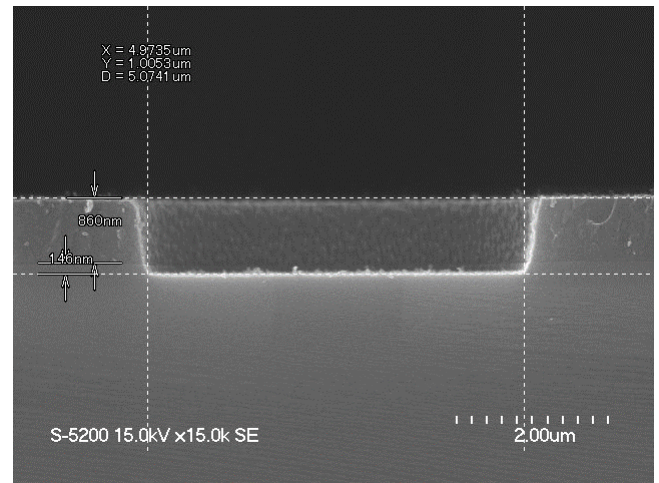
hydrophobic



hydrophilic

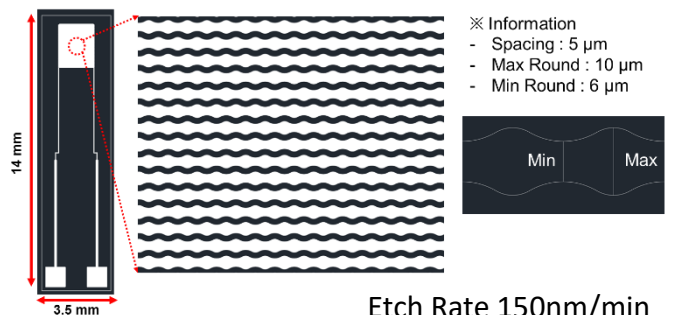


Etching SiO2



Etch Rate 10nm/min

Etching parylene



Etch Rate 150nm/min

上位機種

- COVANCE・COGRADE・COWINシリーズ:
 チャンバー250リットルまで対応可
 量産等に適したプラズマクリーナー
 - VITAシリーズ:
 RIE(反応性イオンエッチング) 高密度プラズマエッチング
 アッシングやエッチング用途に
- ※上位機種に関しては、全てお客様の希望にそったオーダー
 メイドとなります。

FEMTO SCIENCE 国内総代理店



株式会社 **新興精機**

Shinkouseiki.Co.,Ltd

大阪営業所

〒564-0052 大阪府吹田市広芝町7番26号

TEL: 06-6389-6220 FAX:06-6389-6221

● 本社 / 〒812-0054 福岡市東区馬出6丁目14番17号

TEL: 092-624-8010 FAX:092-624-8024

● 営業所 / 北九州・佐賀・熊本・宮崎・鹿児島・東京・名古屋